LaserGasII MP

LaserGas II MPは、近赤外線単線吸収分光法（TDLAS）という原理を採用しており、サンプリングタイプの分析計です。
ppmからppbレベルまでの、より低濃度のガスをリアルタイムに測定することができます。
プロセスや現場設置の都合上、分析計をダクトに直付けすることが難しい場合、本機種は専用のセルが分析計に付随していますので、その測定セル内でサンプリングガス中の対象ガスを測定します。
本分析計は測定セル内でレーザーを何度も反射させることで、低濃度でも再現性の高い測定を実現します。

特徴	アプリケーション
• サンプリング方式 • 低濃度（ppbレベル）まで測定可能 • 組成ガスの干渉を受けない • 有毒ガスや腐食性ガスの測定が可能 • 国内防爆認証取得 • ゼロ/スパンドリフトなし • 定期的な校正の必要なし • メンテナンスコストの削減 • 設置、試運転調整からアフターサービスまで当社で対応	• 電解プラントにおける塩素内の微量H2の測定 • 電解プラントにおけるH2純度の確認 • 製鉄プロセスでの脆化対策 • 石油/化学プラントにおけるプロセスガス中の不純物としてのH2S測定 • 純ガス中の不純物監視 • 低濃度ガスの測定 • 現場都合上ダクト直付けが難しい場所での測定

仕様詳細

仕様	
最大測定長（配管内径）	11.4m（レーザー反射により）
応答速度	約2秒以内
スパン・ドリフト	測定レンジの4％以下
ゼロ・ドリフト	測定レンジの2％以下
外部環境	
環境温度	0°C to +55°C
保管温度	-20°C to +55°C
保護規格	IP65
入力/出力	
アナログ出力	4–20mA (濃度・透過率)
デジタル出力(オプション)	TCP/IP, MODBUS, 光ファイバー
リレー出力	警報リレー、エラーリレー、
アナログ入力	4-20mA (温度/圧力出力可能)
電源仕様	
電源電圧	AC 100V 50/60Hz
電力消費	20W以下
4–20mA 出力	最大500オーム（絶縁）
リレー出力	1A at 30V DC/AC
レーザークラス	
レーザークラス	Class1
CE	認証済み
EMC	2014/30/EUに遵守

防爆承認	
国内防爆（zone2）	Ex ic nA nC IIC T4/T5 Gc Ex tc IIIC T100°C Dc
設置	
ガス 入口/出口	6mmまたは1/4"/ 8mm(5/16") のスウェージロック (その他サイズはご相談ください)
ガス流量	2-10 l/min推奨
入口の圧力	1-1.5 BarA
セルの温度	0-55°C
機内パージ	N2パージ若しくはエアパージ(O2,CO2の測定に限る)
パージフロー	最大 0.5 l/min
メンテナンス	
校正	年1回の機器校正を推奨いたします。
寸法/重量	
外箱	500mmx510mmx215mm 18.5kg

ガス	検出限界(ppm)
O2	10
H2S	0.5
CH4	0.02
CO	0.02
CO2	0.2
HCN	0.05
NH3	0.03
HCl	0.01
H2	200

※検出限界は、温度25°C,圧力1Barの場合のデータとなります。